

## 研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム

### 産学共同(育成型) 事後評価結果

体系的課題番号	: JPMJTR20RE
採 択 年 度	: 2020 年度
分 野	: ICT・電子デバイス、ものづくり分野
研究開発課題名	: 触媒表面基準エッチング法における触媒パッド高度化と精密光学デバイスへの展開
プロジェクトリーダー 研究責任者	: 佐野 泰久(大阪大学)

#### 評価結果の総合所見

本課題は、精密光学デバイスの高性能化、高機能化の実現に向け、純水のみを加工液とした精密表面研磨法の開発を目指すものである。

当初の目標を達成し、企業との共同研究も進んでおり、次の研究開発フェーズ移行に必要な成果が得られた。

市販の卓上研磨機に、開発したパットを用いることで、当該の研磨加工が実施可能であることを実証したことは高く評価できる。今後は、目的に特化した企業との共同プロジェクトが立ち上がることを期待する。

以上